

## 支援装置一覧

支援内容	装置名	詳細
描画装置	電子線描画装置	エリオニクス社製(ELS-7500EX)
	マスクレス露光装置	大日本科研社製(MX-1204)
加工装置	スピコーター	ミカサ社製(MS-B150)
	両面マスクアライナ <sup>※</sup>	ズース・マイクロテック社製(MA6/BA6)
	デュアルイオンビームスパッタ装置	ハシノテック社製(10W-IBS)
	マグネトロンスパッタリング装置 <sup>※</sup>	芝浦メカトロニクス社製(CFS-4EP-LL)
	真空蒸着装置	ULVAC社製(VPC-1100)
	酸化／拡散炉 <sup>※</sup>	DSL社製(VESTA-2100)
	シリコン深堀エッチング装置 <sup>※</sup>	SPPテクノロジーズ社製 (MUC-21 ASE Pegasus)
	反応性イオンエッチング装置 <sup>※</sup>	サムコ社製(RIE-10NR)
	イオンシャワー	エリオニクス社製(EIS-200ER)
	ダイシングマシン	DISCO社製(DAD3220)
ワイヤーボンダ <sup>※</sup>	WEST・BOND社製(Model 7KE)	
評価装置	走査電子顕微鏡(EDS付き)	JEOL社製(JSM-6060-EDS) EDS元素分析
	デジタルマイクロスコープ	ハイロックス社製(KH-7700)
	白色干渉式非接触三次元形状測定器	ブルカー・エイエックスエス社製 (NT91001A-in motion)
	レーザー式非接触三次元形状測定器	三鷹光器社製(NH-3N)
	エリプソメータ	溝尻光学社製(DHA-XA/M8)
	触針式表面形状測定器	アルバック社製(DekTak8)
	触針式表面形状測定器 <sup>※</sup>	ブルーカ・エイエックスエス社製 (DektakXT)
	ウエハプローバー	カール・ズース社製(PM5)
	4探針型薄膜抵抗率計	エヌピーイエス社製(KS-TC-40-SB-VR)

※ が付く装置は香川県が保有する装置であり、使用条件が異なりますので、お問い合わせ下さい。